

像散式量測系統於光學輪廓儀之應用

本院覽號

02T-990826

公告日期

智財權狀態

know-how

摘要

本像散式量測系統可以光學輪廓儀模式量測樣品表面，此光學輪廓儀模式以雷射非接觸式掃描樣品表面，其速度可達掃描探針顯微鏡之千倍以上，可大幅節省掃描時間。

技術優勢

一般傳統掃描探針顯微術（SPM）使用光槓桿原理來偵測SPM探針的位移，無法使用雷射光直接掃描樣品表面。以像散式量測系統（ADS）為核心的多模式量測光路除了可使用ADS偵測AFM探針的位移，還可使用ADS直接非接觸式量測樣品表面之形貌與光學特性。

應用範圍

奈米級量測前以微米級方式預覽：掃描探針顯微術-以光學輪廓儀模式對樣品表面作粗掃。

創作人

胡恩德



中央研究院
ACADEMIA SINICA